



DAE ZHU

PATENT
Attorney Docket No. 16869S-032100US

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of:

Hidetoshi Nishiyama et al.

Patent No.: 6,797,975 B2

Issue Date: September 28, 2004

Serial No.: 09/931,997

Filed: August 17, 2001

For: Method and Its Apparatus for Inspecting
Particles or Defects of A Semiconductor
Device

Examiner: Kevin K. Pyo

Art Unit: 2878

PETITION FOR
CERTIFICATE OF CORRECTION

Mailstop Petitions
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1430

Sir:

Pursuant to 37 CFR 1.183, Applicants respectfully request that the Commissioner waive 37 CFR 3.81(a) to permit the correct names of the assignees to be provided after issuance of the above referenced patent. The name of one of the two Assignees has had a name change. A copy of the Notice of Recordation of Assignment Document for this case is enclosed.

Pending approval of this petition and pursuant to 37 CFR 1.323, Applicants respectfully request issuance of a Certificate of Correction to change Assignees name to Hitachi, Ltd. and Hitachi High-Technologies Corporation in the above patent. Hitachi High-Technologies Corporation is located at 24-14, Nishishinbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan. A Certificate for Name Change is included. The desired corrections are set forth on the enclosed Form PTO 1050.

The required Petition fee in the amount of \$130.00 and Certificate of Correction fee in the amount of \$100.00 are hereby submitted (see Fee Transmittal submitted in duplicate).

Upon approval of Applicants' Petition, please forward the file to the Certificates of Correction Branch for issuance of a Certificate of Correction.

09/15/2005 HVUONG1 00000022 201430 6797975

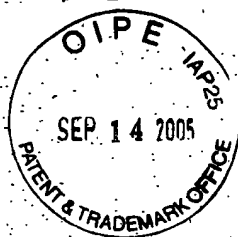
02 FC:1464 130.00 DA

September 12, 2005

Respectfully submitted,

George B. F. Yee
George B. F. Yee
Reg. No. 37,478

TOWNSEND and TOWNSEND and CREW LLP
Two Embarcadero Center, 8th Floor
San Francisco, California 94111-3834
Tel (650) 326-2400 / Fax (650) 326-2422
60583582 v1



COPY

Certificate of All of Currently Effective Matters Recorded in
Corporate Register

Address: 16-3, Higashi 3-chome, Shibuya-ku, Tokyo

Name: Hitachi High-Tech Electronics Engineering Co., Ltd.

No. Of Company, Corporation, etc.: 0110-01-019607

Trade name: Hitachi Electronics Engineering Co., Ltd.

Hitachi High-Tech Electronics Engineering Co., Ltd.

Changed on April 1, 2004

Registered on April 2, 2004

Head office: 16-3, Higashi 3-chome, Shibuya-ku, Tokyo (Japan)

Date of incorporation: February 11, 1965

* The underlined indicates the erased matters
(Other items are not applicable)

(Page 1/2)

Matters relating to officers:

Board Director (President)

Hiroshi MIZUSAWA

Reappointed on June 24, 2003

Registered on June 24, 2003

Board Director

Kenya WADA

Reappointed on June 24, 2003

Registered on June 24, 2003

Board Director

Masumi NUKUMI

Reappointed on June 24, 2003

Registered on June 24, 2003

Board Director

Koichi TAJIMA

Took office on April 1, 2004

Registered on April 2, 2004

Board Director

Hiroshi ISHIKAWA

Took office on April 1, 2004

Registered on April 2, 2004

Board Director (Outside Director)

Tamio MORI

Took office on April 1, 2004

Registered on April 2, 2004

Best Available Copy

Representative Director

Hiroshi MIZUSAWA

of 23, Okazaki 6991, Isehara-shi, Kanagawa

Took office on April 1, 2004

Registered on April 2, 2004

Corporate Auditor

Kazuhiko MIYAZAKI

Took office on June 24, 2003

Registered on June 24, 2003

Corporate Auditor

Hiroshi KANEUCHI

Took office on April 1, 2004

Registered on April 2, 2004

Corporate Auditor

Hiroshi MISAWA

Took office on April 1, 2004

Registered on April 2, 2004

This is a document certifying that the foregoing presents all the matters that are recorded in the company's register and are currently effective.

June 18, 2004

Masayuki Saito /official seal/

Registrar

Shibuya Branch Office

The Tokyo Legal Affairs Bureau

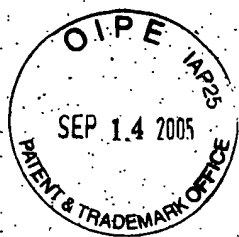
Serial No. 1279270

* The underlined indicates the erased matters

(Page 2/2)

(Other items are not applicable)

Best Available Copy



現在事項全部証明書

東京都渋谷区東三丁目16番3号
日立ハイテク電子エンジニアリング株式会社
会社法人等番号 0110-01-019607

商号	日立電子エンジニアリング株式会社	
	日立ハイテク電子エンジニアリング株式会社	平成16年 4月 1日変更 平成16年 4月 2日登記
本店	東京都渋谷区東三丁目16番3号	
公告をする方法	官報に掲載してこれをおこなう	平成14年10月29日変更
		平成14年10月30日登記
貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項	http://www.hitachi-de.co.co.jp/index.html	平成14年 5月31日設定
		平成14年 6月 4日登記
会社成立の年月日	昭和40年2月11日	
目的	1 磁気ディスクの製造装置ならびに検査装置等の製造および販売 2 半導体の製造装置ならびに検査装置等の製造および販売 3 液晶パネルの製造装置ならびに検査装置等の製造および販売 4 自動組立機等省力機器の製造および販売 5 コンピュータ・通信等に関する情報周辺機器の製造および販売 6 画像解析装置等バイオテクノロジー関連機器の製造および販売 7 医療機械器具の製造および販売 8 鉄道用検測装置ならびに護身用警報器具等電子応用機器の製造および販売 9 前各号に関連する据付、修理および保全 10 ソフトウェアの作成および販売 11 前各号に関連する一切の事業 平成11年 6月29日変更 平成11年 7月 9日登記	
一単元の株式の数	1000株	
発行する株式の総数	7200万株	
発行済株式の総数並びに種類及び数	発行済株式の総数 3041万5000株	平成14年 4月17日変更
		平成14年 4月26日登記
資本の額	金40億2494万円	平成14年 4月17日変更
		平成14年 4月26日登記

整理番号 1279270

* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

1/2

Best Available Copy

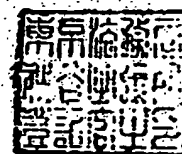
東京都渋谷区東三丁目16番3号
日立ハイテク電子エンジニアリング株式会社
会社法人等番号 0110-01-019607

名義書換代理人の 氏名及び住所並び に常業所	東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 東京証券代行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 東京証券代行株式会社 本店	
役員に関する事項	取締役 水 澤 浩	平成15年 6月24日重任 平成15年 6月24日登記
	取締役 和 田 憲 也	平成15年 6月24日重任 平成15年 6月24日登記
	取締役 生 見 益 三	平成15年 6月24日重任 平成15年 6月24日登記
	取締役 田 島 孝 一	平成16年 4月 1日就任 平成16年 4月 2日登記
	取締役 石 川 寛	平成16年 4月 1日就任 平成16年 4月 2日登記
	取締役 森 民 生 (社外取締役)	平成16年 4月 1日就任 平成16年 4月 2日登記
	神奈川県伊勢原市岡崎6991番地の23 代表取締役 水 澤 浩	平成16年 4月 1日就任 平成16年 4月 2日登記
	監査役 宮 崎 一 彦	平成15年 6月24日就任 平成15年 6月24日登記
	監査役 金 内 寛	平成16年 4月 1日就任 平成16年 4月 2日登記
	監査役 三 澤 寛	平成16年 4月 1日就任 平成16年 4月 2日登記

これは登記簿に記録されている現に効力を有する事項の全部であることを証明した書面である。

平成16年 6月18日
東京法務局渋谷出張所
登記官

齋 藤 正

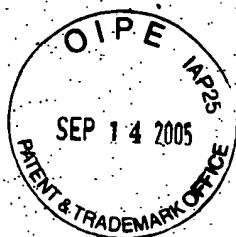


整理番号 1279270

* 下線のあるものに抹消事項であることを示す。

2/2

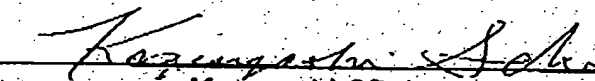
Best Available Copy



DECLARATION

I, Kazuyoshi SEKI, a national of Japan, c/o Asamura Patent Office of 331-340, New Ohtemachi Building, 2-1, Ohtemachi-2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan, declare that to the best of my knowledge and belief the attached is a true and faithful partial-translation into English made by me of a CERTIFICATE OF ALL OF CURRENTLY EFFECTIVE MATTERS RECORDED IN CORPORATE REGISTER issued by Tokyo Legal Affairs Bureau on June 18, 2004 attached hereto.

Signed this 11th day of August 2004.


Kazuyoshi SEKI

Best Available Copy



PATENT
Attorney Docket No. 16869S-032100US

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of:

Hidetoshi Nishiyama et al.

Patent No.: 6,797,975

Filed: August 17, 2001

For: Method and its Apparatus for
Inspecting Particles or Defects of a
Semiconductor Device
Customer No.: 20350

REQUEST FOR CERTIFICATE OF
CORRECTION

Attn: Certificate of Correction Branch
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Pursuant to 37 CFR 1.322 Applicant submits a Certificate of Correction to correct the name of Assignee, Hitachi High-Technologies Corporation (Name Change document attached).

The desired correction is set forth on form PTO/SB/44, enclosed.

Please deduct the fee, pursuant to 37 CFR §1.20(a), of \$100.00 from deposit account 20-1430 and any additional fees associated with this Certificate.

Respectfully submitted,

George B. F. Yee
Reg. No. 37,478

09/15/2005 HVUONG1 00000022 201430 6797975

01 FC:1811 100.00 DA

TOWNSEND and TOWNSEND and CREW LLP
Two Embarcadero Center, Eighth Floor
San Francisco, California 94111-3834
(415) 576-0200
Fax (415) 576-0300
GBFYrev. 10/03

60583544 v1

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE CERTIFICATE OF CORRECTION

PATENT NO : 6,797,975
DATED : September 28, 2004
INVENTOR(S) : Hidetoshi Nishiyama et al.

It is certified that error appears in the above-identified patent and that said Letters Patent is hereby corrected as shown below:

Title page, left column

(73) Assignees: Hitachi, Ltd., Tokyo (JP)
Hitachi High-Technologies Corporation, Tokyo (JP)

MAILING ADDRESS OF SENDER: TOWNSEND and TOWNSEND and CREW LLP

Two Embarcadero Center, Eighth Floor
San Francisco, California 94111-3834

Docket No.: 16869S-032100US

60583549 v1

PATENT NO. 6,797,975

No. of additional copies: 10

